磁光调制和法拉第旋转测量

刘 公 强 (上海交通大学应用物理系)

湘 刘 枺 (中国科学院上海冶金研究所)

提 要

本文描述石榴石单晶薄膜磁光调制器的基本特性。文中论述了磁光调制倍频法测量法拉第旋转角 9 的基本原理和方法,讨论测试结果,分析测量误差。指出其优点是用这种新方法测得的母将不受激光源幅 度变化以及光路中其它元器件不稳定因素的影响,测量精度达±0.020°。

一束线偏振光通过具有磁矩的物质(以下简称为介质)后,其偏振面相对于入射线偏振 光发生了一定的旋转,这个现象称为法拉第磁光效应,法拉第旋转角θ为^[1]

$$\theta = (\pi z/\lambda) \left(n_{-} - n_{+} \right) = \theta_F z, \tag{1}$$

式中 λ 为真空中光波的波长, z为光在介质中传播的距离, n_+ 、 n_- 分别为介质的右旋和左 旋圆偏振光的折射率, θr 为光传播方向单位长度的旋转角, 称为法拉第旋光率或称比法拉 第旋转。

关于法拉第旋转角测量已有一些报道^[3,3],但在那些测量装置中,由于激光源、光路中 其它元器件的不稳定以及被测样品透射率的大小,都对测量结果带来一定的误差。本文介 绍的磁光调制倍频法测量法拉第旋转角θ,将避免这一致命的弱点,从而提高了测量精度和 重复性。

一、原理与方法

根据 Malus 定律, 通过起偏器, 经检偏器输出的光强为

$$I(\alpha) = I_0 \cos^2 \alpha, \qquad (2)$$

式中 α 为起偏器和检偏器透光轴之间的夹角, I_0 为 $\alpha=0$ 时的输出光强。在两个偏振器之间插入一个由磁化线圈 交变磁化了的磁光石榴石单晶或单晶薄膜样品,构成一 个磁光调制器,如图1所示。设由交变电流产生的交变 磁场 H 引起的交变法拉第旋转角为 θ' ,则如图1系统的 输出光强变为

$$I(\alpha + \theta') = I_0 \cos^2(\alpha + \theta')$$

= (I_0/2) [1 + cos 2(\alpha + \theta')] (3)



数字低频信号源

起偏器

石榴石单晶薄膜



收稿日期: 1983年12月5日; 收到修改稿日期: 1984年2月7日

当用正弦波电流输入调制线圈,则在垂直石榴石单晶薄膜平面的方向上产生一个正弦变化 的交变磁场,由此引起的交变法拉第旋转角 θ' 为

$$\theta' = \theta'_0 \sin \omega t, \tag{4}$$

式中 θ_0^{\prime} 是交变法拉第旋转角 θ' 的幅度,称为调制幅度。由上可知,当 α 一定时,输出光强 I 仅随 θ' 变化,而 θ' 是受磁场 H 控制的,因此 I 随 H 而变化,这就是光强的磁光调制。显然,由于交变磁场 H 引起的法拉第旋转使输出光强幅度变化(磁光调制幅度)为

$$I_{0}\cos^{2}(\alpha - \theta_{0}') - I_{0}\cos^{2}(\alpha + \theta_{0}') = I_{0}\sin 2\alpha \sin 2\theta_{0,0}'$$
(5)

由(3)、(5)两式可知:

(1) 当 θ_0 为定值时, 磁光调制幅度随 α 而变化。 $\alpha = 45^\circ$ 时, 磁光调制幅度最大(如图 $2(\alpha)$ 所示)。此时由(3)式得

$$I(45^{\circ} + \theta') = (I_0/2) (1 - \sin 2\theta'), \tag{6}$$

I随 θ' 作正弦变化。



图 2 波形的变化 Fig. 2 Change of wave form

(2) 当 α =45° 时, θ_0 =45° 磁光调制幅度最大。 由(6)式可以看出, 当 θ_0 >45° 时, 调制波形将产生畸变(如图 2(*b*)、2(*c*)所示)。

(3) 当 $\alpha \neq 45^{\circ}$ 时, *I* 不仅与 θ' 有关, 而且与 α 的变化也有关, 因此调制波形及其幅度 将随起偏器和检偏器相对位置 α 值而变化, $\theta'_0 < 45^{\circ}$ 也会引起调制波形的畸变。

当 α=90°,即两偏振器处于正交位置时,输出光强为

(c)

$$I(90^{\circ} + \theta') = I_0 \cos^2(90^{\circ} + \theta') = (I_0/2) (1 - \cos 2\theta')_{\circ}$$
⁽⁷⁾

此时, *I* 是 θ' 的偶函数, 输出光强仅与 θ' 的大小有关, 即与交变磁场 **H** 的大小有关, 与磁 场的方向无关。显然, 此时输出调制信号的频率是输入调制信号频率的一倍(如图 2(*d*)所 示)。由此可见, 当我们用图 3 所示的测量装置检测倍频信号时, 即可确定两偏振器处于正 交("消光")位置。

 $当 \alpha = 0^{\circ}$ 时,输出光强为

$$I(\theta') = I_0 \cos^2 \theta' = (I_0/2) (1 + \cos 2\theta'), \tag{8}$$



图 3 测量装置示意图 Fig. 3 Schematic diagram of measurement installation

输出光强 I 的变化情况与 $\alpha = 90^{\circ}$ 时相类似。从(7)、(8) 两式可以看出, 在 $\alpha = 0^{\circ}$ 、90° 情况 下, 磁光调制(倍频信号) 幅度随 θ_0 的增大而增大, 而 $\theta_0 = 90^{\circ}$ 时, 其幅度最大。

法拉第旋转测量装置如图 3 所示。由激光器出射的激光通过起偏器后成为线 偏 振 光, 经磁光调制器调制后进入被测样品,出射后偏振面旋转了 θ 角。 被调制和旋转后的线偏振 光入射到检测器,转换成交变的光电流,经放大器放大后输入示波器的 y 轴,在示波荧光屏 上就显示出被调制的信号。

旋转测角仪, 检偏器就与之同轴旋转, 当 α+θ=90°("消光"位置)时, 示波器上再次出现倍频信号。 根据被测样品放入前后两次出现倍频信号时的测角仪位置, 即可确定被测样品的法拉第旋转角θ。这个测量方法我们称之为磁光调制倍频法。

二、实验结果和讨论

1. 磁光调制

将图 3 测量装置中的被测样品取下,即可用作磁光调制器特性的测量。

磁光调制器所用样品为[111]Gd₃Ga₅O₁₂衬底上液相外延的(BiPrGdYb)₃(FeAl)₅O₁₂ 单晶薄膜¹⁴,厚度视光源波长等具体情况而定,我们选用的薄膜厚度为20 µm。调制频率可 在 0~200kHz 范围内任意选择,但需注意随着频率的增加,由于 *M* 相对于 *H* 的滞后效应



图 4 波形随 a 的变化 Fig. 4 Change of wave form with a 和磁化线圈的阻抗变化, 使 θ' 逐步降低, 调制幅度相应 下降。 波长在 0.55~6 μm 范围内的光源均可使用, 但需配 备相应的检测器。

在输入光强及调制磁场幅度不变的情况下,改变 α,由 示波器显示的输出调制波形变化如下:

(1) α=45°时, 磁光调制幅度最大, 如图 4(b) 所示。

(2) α→0°或 90°时, 磁光调制幅度逐渐减小, 波形变
 化如图 2 所示。

(3) α=0°或90°时,磁光调制幅度最小,调制频率为
 输入调制频率的倍频,如图 4(a)、(b)所示。

由上可见,实验和理论取得了很好的一致。

2. 法拉第旋转测量

将被测样品装入如图 3 所示装置的直流磁场中。被测样品是[111] Gd₃Ga₅O₁₂ 衬底上液 相外延的(BiTm)₈(FeGa)₅O₁₂ 单晶薄膜^[5], 厚度为4.37 μm, 光源是波长为 6328 Å 的 He-Ne 激光。

用 磁 光 调 制 倍 频 法 测 得 的 $\theta_F \sim H$ 曲 线 如 图 5 所 示 ($\theta_F = \theta/2h$,其中 h 为单面膜厚度)。在 H < 82 Oe 时,这种磁光 石榴石单晶薄膜的 $\theta_F \sim H$ 基本上成线性关系。当 H > 82 Oe 时, θ_F 趋近于饱和值,这与该材料的磁化强度 M 趋近于饱和 值 M_s 有关。

用磁光调制倍频法测量法拉第旋转有如下两个特点:

(1) 磁光调制的测量灵敏度高,调制深度可用磁场灵活 控制。磁光调制器结构简单,操作方便,与电光调制器等相 比,所需的驱动功率小。

(2)激光源的不稳定,调制磁场的变化,以及光路中其它元器件的不稳定,主要影响调制信号的幅度变化,不会影响调制信号的频率。即使磁光调制频率有些变化,或者光路中有影响调制频率的因素存在,由于采用观察或测量倍频信号的方法,都不会影响法拉第旋转角 θ的测量结果。

产生误差的主要因素:

(1) 由于测角仪精度限制而引入的读数误差, 其值为 0.005°;

(2) 示波器观察倍频信号的方法,因目视的判别而引入误差。

为了减少上述两个因素引入的误差,将直流磁场反向后重测一次,法拉第旋转角取直 流磁场正向和反向时测得的测角仪读数的平均值。 经多次测量证明,本装置的测量精度为 0.020°。

三、结 论

(1) 掺 Bi 稀土铁石榴石单晶薄膜磁光调制器结构简单, 驱动功率低, 调制深度随交变 磁场连续可调, 调制频率范围较宽, 这是一种有较大应用前景的新型调制器。

(2) $\alpha = 45^{\circ}$ 、 $\theta_0 = 45^{\circ}$ 时, 磁光调制器的磁光调制幅度最大; $\alpha = 0^{\circ}$ 和 90°时, 磁光调制 幅度最小, 此时输出调制信号频率为输入调制信号的倍频。

(3)用磁光调制倍频法测量磁光材料的法拉第旋转角θ,不受激光源幅度变化、被测样品透射率大小等因素的影响,用读数精度为±0.005°的测角仪测量时,其精度可达±0.020°,对于θ≥2°的样品,所得数据的误差≤1%。

参考文献

[1] J. F. Dillon Jr.; «Magnetic Properties of Materials», (J. Smit, McGraw-Hill, 1971), 152.

- [3] H. Hayms, E. Feldtkeller; Rev. Scient. Instrum., 1973, 44, No. 6 (Jun), 742.
- [4] 刘湘林,王洪祥; «中国激光», 1983, 10, No. 10 (Oct), 723.



图 5 $\theta_F \sim H$ 曲线 Fig. 5 Specific Faraday rotation θ_F vs applied field H

^[2] 阿部正纪; «応用物理», 1981, 50, No. 7 (Jul), 729.

[5] 刘湘林等; «应用科学学报», 1984 (待发表)。

Magneto-optic modulation and measurement of Faraday rotation

LIU GONGQIANG (Department of Applied Physics, Shanghai Jiao-Tong University)

LIU XIANGLIN (Shanghai Institute of Metallurgy, Academia Sinica)

(Received 5 December 1983; revised 7 February 1984)

Abstract

Main properties of magneto-optic modulators with single crystal films of garnets, the basic principle and the experimental installation of the measurement of Faraday rotation angle θ by means of the frequency doubling method of magneto-optic modulation are described. The means and merits of the measurement are presented, the results measured are discussed, and the measuring error is analysed. The Faraday rotation angle θ measured with the new means is not effected by the light intensity change of a laser source and unstable factors of other devices in a optical circuit, so that the measuring precision is $\pm 0.020^{\circ}$.